

開講年度	開講学部等		
2018	共通教育		
開講学期	曜日時限	授業区分	AL(アクティブ・ラーニング)ポイント YFL育成プログラム
前期集中	集中	講義	4.9ポイント
時間割番号	科目名[英文名]		単位数
1001220002	知財展開科目 [特許法] [Intellectual Property Development Subject]		1
担当教員[ローマ字表記]			
村井 礼 [MURAI Hiroshi]			
授業科目区分		対象学生	平成25年度以降入学者 対象年次 1～
開設科目名(英訳)			

特許法 (Patent Law)

使用言語

日本語

概要(共通教育の場合は平易な授業案内)

知的財産制度の全体像を解説するとともに、企業における知的財産権の創造、保護及び活用のプロセスを解説する。特許制度とは、「発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする(特許権法一条)」発明に関する特別法である。この授業では、この特許法を取扱い、特許制度に関しての法律の理解を基礎とし、特許権の権利の発生から消滅までの権利の一生の解説を行う。さらに、特許権を題材に知的財産の評価手法の解説を行う。また、特許制度だけでなく、特許制度と同質の考案を保護する実用新案権やグローバル化に伴いパリ条約、PCT等の条約の解説を行い、国内の特許法の位置づけの明確化を図る。

一般目標

1. 特許制度に関わる法制度を理解する。
2. 特許法の意義とその趣旨を理解する。
3. 特許制度について事例や演習を取扱いながら、グローバル化を視野に入れた実践的な能力の育成を目指す。

授業の到達目標

知識・理解の観点	<ul style="list-style-type: none"> ・ 特許制度の観点から知的財産を把握し、事業戦略遂行あるいは知財マネジメント(創造・保護・活用)の各局面について説明できる。 ・ 知的財産の権利の発生から消滅までについて特許制度の観点から説明できる。 ・ 事業戦略の観点から特許制度について理解できる。
思考・判断の観点	<ul style="list-style-type: none"> ・ 特許権制度について、各局面の事実関係に対応する権利を客観的に把握することができる。 ・ 特許制度の観点から、発明に該当する否かが判断できる。 ・ 特許制度の観点から、特許権の権利範囲を把握することができる。
関心・意欲の観点	<ul style="list-style-type: none"> ・ 特許制度の客体に関心を持つことができる。 ・ 特許の権利化および実務上の管理に関心を持つことができる。 ・ 特許制度を活用し、初歩的な個別事業戦略立案に取り組むことができる。
態度の観点	<ul style="list-style-type: none"> ・ 特許制度を積極的に理解し、権利化を推進することができる。 ・ 特許法の客体把握に自立的な取り組みができる。 ・ 特許の権利化および管理について、入門レベルの処理ができる。 ・ 初歩的な個別事業戦略立案において、特許制度の観点を含めた総合的かつ最適化された企画を行うことができる。
技能・表現の観点	<ul style="list-style-type: none"> ・ 与えられた課題に沿って、特許法の客体を把握することができる。 ・ 発明について、入門レベルで権利化へのアプローチを検討することができる。 ・ 個別事業戦略を立案において、特許制度を活用して効果的な提案をすることができる。

授業計画

本科目では、特許法における様々な制度の解説を行うとともに、特許法に関する条約などの国際的な条約についての理解を深める。特許取得までの流れを理解し、特許制度を切り口に事業戦略に組み込む方法を解説する。

2日間の集中講義で、吉田キャンパスで開講します。

【開講予定日】

6月23日(土) 8:40~16:00

6月30日(土) 8:40~16:00

※この科目は、共通教育展開科目として開講しています。同時に、山口大学知的財産教育履修認定プログラム(BP)として提供される科目(1単位15時間)です。なお、履修認定プログラムにおいても科目の修得基準は60点以上です。また本科目では教員と学生が双方向で議論する授業を行います。

【週単位】

AL(アクティブ・ラーニング)欄に関する注

A~Fのアルファベットは、以下の学修形態を指しています。

【A：グループワーク】、【B：ディスカッション・ディベート】、【C：フィールドワーク（実験・実習、演習を含む）】、【D：プレゼンテーション】、【E：振り返り】、【F：宿題】

【多】、【中】、【少】は授業時間内におけるALが占める時間の割合を指しています。

【多】：授業時間の50%超、【中】：授業時間の15%～50%、【少】：授業時間の15%未満。「振り返り」と「宿題」については該当する場合に【あり】と表示されます。

項目	内容	授業外指示	授業記録	評価					
				A	B	C	D	E	F
第1週	講義概要（ガイダンス） 知的財産制度の概要			【少】 （授業時間の15%未満）	【少】 （授業時間の15%未満）	【少】 （授業時間の15%未満）	【少】 （授業時間の15%未満）	-----	-----
第2週	特許制度			【少】 （授業時間の15%未満）	【少】 （授業時間の15%未満）	【少】 （授業時間の15%未満）	【少】 （授業時間の15%未満）	【あり】	-----
第3週	特許制度			【少】 （授業時間の15%未満）	【少】 （授業時間の15%未満）	【少】 （授業時間の15%未満）	【少】 （授業時間の15%未満）	【あり】	-----
第4週	特許情報			【少】 （授業時間の15%未満）	【少】 （授業時間の15%未満）	【少】 （授業時間の15%未満）	【少】 （授業時間の15%未満）	【あり】	-----
第5週	実用新案権の概要			【少】 （授業時間の15%未満）	【少】 （授業時間の15%未満）	【少】 （授業時間の15%未満）	【少】 （授業時間の15%未満）	【あり】	-----
第6週	職務発明他			【少】 （授業時間の15%未満）	【少】 （授業時間の15%未満）	【少】 （授業時間の15%未満）	【少】 （授業時間の15%未満）	【あり】	-----
第7週	まとめ（特許制度及び実用新案権）			【少】 （授業時間の15%未満）	【少】 （授業時間の15%未満）	【少】 （授業時間の15%未満）	【少】 （授業時間の15%未満）	【あり】	-----
第8週	まとめ（特許制度及び実用新案権）と試験			【少】 （授業時間の15%未満）	【少】 （授業時間の15%未満）	【少】 （授業時間の15%未満）	【少】 （授業時間の15%未満）	【あり】	-----

4.9ポイント

成績評価法

授業内レポートや課題，授業態度・授業への参加度，出席等を総合的に評価する。

	知識・理解	理 断	思 考	判 断	関 心	意 欲	態度	技能・表現	その他	評価割合（%）	JABEE収集資料
定期試験（中間・期末試験）										50%	---
小テスト・授業内レポート										40%	---
宿題・授業外レポート										---	---
授業態度・授業への参加度										10%	---
受講者の発表（プレゼン）・授業内での制作作品										---	---
演習										評価に加えず	---
出席										欠格条件	---
その他										評価に加えず	---

ファイル名

備考

ルーブリック等の評価基準	設定されていません。	

(注)ルーブリックとは、評価水準である「尺度」と、尺度を満たした場合の「特徴の記述」で構成される評価指標のことを言います。

教科書にかかわる情報

教科書その他の情報

授業開始時に教科書を無償で配布します。

参考書にかかわる情報

参考書その他の情報

教材は下記HPからも配信します。

<http://www.kim-lab.info/>

メッセージ

キーワード

特許権，知的財産，発明，実用新案権，考案，特許侵害，特許評価，パリ条約，PCT，不正競争防止法

関連科目

科学技術と社会[学部生のための知財入門]

知的財産情報の取得と活用

ものづくりと知的財産

意匠法

商標法

不正競争防止法

著作権法

連絡先

村井 muraip@yamaguchi-u.ac.jp

オフィスアワー